

IoN40

Система плазменной обработки поверхностей

Плазменная обработка поверхностей все чаще применяется для очистки поверхностей, благодаря своей высокой эффективности и экономичности. Система плазменной обработки IoN40 представляет собой одну из последних разработок компании PVA TePla. Модель IoN40 оснащена высокочастотным плазменным источником, улучшенной системой контроля процесса, звуковым оповещением для предотвращения ошибок в работе системы, имеет компактный дизайн для настольного применения.

Система плазменной обработки IoN40 идеально подходит для лабораторного применения или производства.



Достоинства модели IoN40:

- Перенастраиваемая камера может быть приспособлена для различных конфигураций электрода для обработки сложных трехмерных образцов средних размеров или для обработки большого количества образцов малых размеров
- Удобный графический интерфейс пользователя
- Промышленный компьютер с ОС Windows
- Удаленный статистический контроль процессов через Интернет
- Редактор рецептов для быстрого пошагового контроля функциональности системы
- LCD сенсорный дисплей и клавиатура
- Встроенные методы диагностики, запись сообщений об ошибках
- Высокое качество очистки поверхностей
- Высокая повторяемость

Основные характеристики системы IoN40

Рабочая камера	Материал	Алюминий
	Объем	36,5 л
	Внутренние размеры	229x330x483 мм
Доступные электроды	Первичная плазма	Вертикальный электрод
		Боковой пристеночный электрод
		Съемные полки 3я и 5я, размеры лотка 289x234 мм
		3я полка с температурным контролем
	Низкодисперсный электрод	
	Электрод вторичной плазмы	
Плазменный источник (воздушное охлаждение)	Частота	100 кГц
	Мощность	0-300 Вт
Рабочий газ	Контроль массового расхода	До 8 рабочих газов
	Рабочее давление (зависит от насоса и расхода газа)	$1.6 \times 10^{-4} - 2.7 \times 10^{-3}$ бар
	Время откачки (зависит от насоса)	Около 1 мин.
	Продувка	Регулируемая
Требуемые подключения	Электропитание	220 В, 1 ф., 50-60 Гц
	Рабочий газ	1-2 бар
	Вентиляция/продувка	1-2 бар
	Сжатый воздух	5 бар
Габаритные размеры (Д x В x Ш)		775 x 723 x 781 мм
Вес		156.36 кг

Доступные опции для системы IoN40:

- Контроллер давления
- Световая колонна для визуальной передачи системных сообщений
- RF генератор 300 или 600 Вт, 13,56 МГц
- Выбор альтернативного источника газа
- Нержавеющая сталь для MFC контроллера
- Считыватель штрих-кодов
- Моделирующее ПО для редактирования рецептов
- Спектрометрический детектор конечной точки
- Вакуумные насосы (роторный пластинчатый насос / сухой и спиральный)
- Принтер
- Стол
- Система охлаждения (чиллер)